



◆ 啞光黑色成膜

- ◆ 超過光學密度 (OD) 5、具備高遮光率的噴墨成膜工藝
- ◆ 實施低反射處理，實現反射率(R%)0.1% 和 明度 (L*) 1

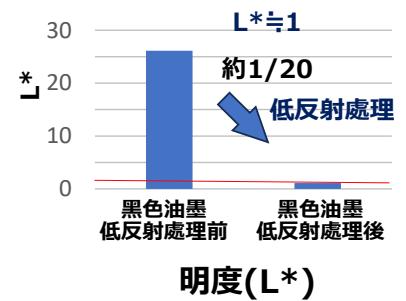
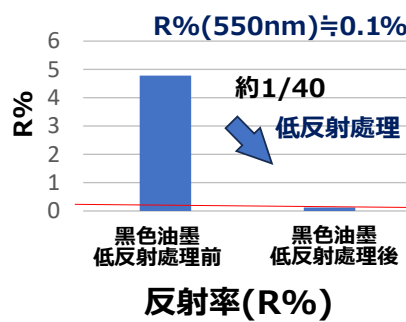
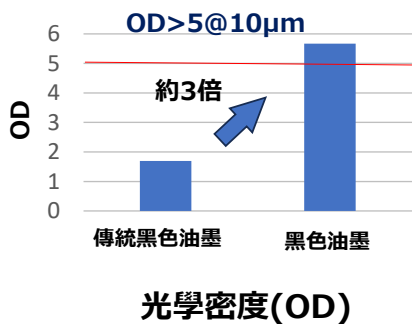
- 成膜材料 噴墨用黑色塗佈
- 成膜基板 玻璃基板 (□30mm)
- 膜厚 10μm
- 液滴量 30pL/drop



光學密度(OD) 2



光學密度(OD) 5



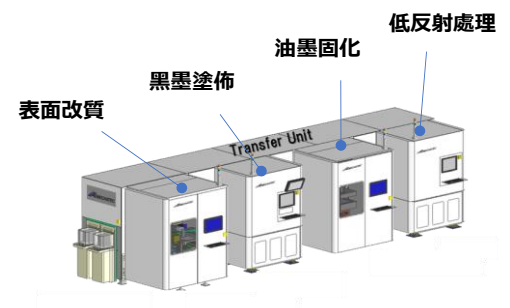
- ◆ 各類基材改質開始至成膜處理的一站式交鑰匙工藝設備

◆ 噴墨工藝的特徵

- 在適當的位置塗佈最適的塗佈量實現自由圖案
- 標準配備：獨自的膜厚控制（漸變塗佈）塗佈技術
- 標準配備：抑制咖啡環效應（膜邊隆起）的塗佈控制技術

◆ 適用例

- 高性能攝像頭模組、鏡頭、稜鏡等：超低反射、高遮光性
- AR/VR光學系：透過部分遮光，提高對比度、降低雜散光
- 雷射光源：高遮光



交鑰匙 工藝設備

Nano-Lithotics Technologies Inc.

6-1-1 Fujimi Tsurugashima-shi Saitama-ken 350-2201 Japan

<https://www.n-lt.com>